## 低エネルギ生体融着デバイスの開発-圧力測定機構の付加-

## Development of adhesion device using low-level energy -pressure measurement unit-

○ 丸岡寛明(茨城大学)
増澤 徹(茨城大学)
橋本英子(茨城大学)
青代敏行(松江工業高等専門学校)
岸田晶夫(東京医科歯科大学)
舩本誠一(札幌医科大学)
樋上哲哉(札幌医科大学)

Hiroaki MARUOKA, Ibaraki University Toru MASUZAWA, Eiko HASHIMOTO, Ibaraki University Toshiyuki AODAI, Matsue College of Technology Akio KISHIDA, Tokyo Medical and Dental University Seiichi Funamoto, Tetsuya HIGAMI, Sapporo Medical University

**Abstract:** We have developed an adhesion forceps using integrated low-level energies of heat and pressure. In this study, forceps pressure measurement unit is developed using force measurement sensors. A force sensitive resistor and a strain gauge are evaluated as the force measurement sensor. The force sensitive resistor has unstable and non-liner characteristic. The strain gauge has stable and linier characteristics and is good to measure the forceps pressure in the range of 0-12 MPa.

Key Words: Adhesion, Surgical device, Force Sensitive Resistor, Strain gauge

### 1. 緒言

我々は、低エネルギの熱・圧力を複合して生体組織に与 えることで、低損傷で高強度な血管止血を実現する新しい 鉗子型融着デバイスの開発を行っている<sup>(1)</sup>.これまでのデ バイスでは、接合時に試料にかかる圧力は施術者の握力に より、その調整が困難であることが課題であった.そこで 本研究では接合時に試料にかかる圧力を計測するため、デ バイス把持部にセンサを取り付けた.センサとして感圧セ ンサとひずみゲージを比較検討した.

#### 2. 装置概要

#### 2.1. 鉗子型接合実験装置概要

図 1 に鉗子型融着デバイスとヒータ構造の概略図を示 す. 本デバイスは全長 238 mm の鉗子型である. デバイス 先端にヒータを配置して、生体組織を挟むことで熱と圧力 を与える. ヒータは断面積が幅1mm,長さ10mmのアル ミニウム片に長さ 35 mm, 抵抗 33.78 Ω/m のニクロム線を 巻いたものを用いた.またヒータ周囲に断熱材の PTFE を 配置した. 温度制御システム構成を図2に示す. 温度制御 はデジタル PID 制御器,専用 PWM アンプと熱電対を用い て行う. ヒータで生体組織を挟むまでの温度を予熱温度, 挟んでいるとき生体組織が熱電対に触れるためこの温度を 生体組織温度と定義する. デジタル PID 制御器は熱電対に よって計測された温度と目標温度の差より操作量を生成す る.操作量は専用 PWM アンプに入力され PWM 信号に変 換される. PWM 信号を PWM アンプ内の FET で増幅し, ヒータに流す電流をスイッチング制御することで、予熱温 度と生体組織温度を制御する.目標温度を予熱温度とする か生体組織温度とするか手元のスイッチにより切り替える. 2.2. センサ概要

先端にかかる圧力計測方法として,以下の2種類の方法 を検討した.

①把持部圧力を INTERLINK ELECTRONICS 社製感圧 センサで計測する方法

②鉗子部のひずみから KFG 汎用箔ひずみゲージで計測 する方法 2.2.1. 感圧センサ概要

図3に感圧センサの構造概略図を示す.非操作時は電極 とカーボンシートに隙間があり導通しないため抵抗が無限 大になる.センサに力が加わると電極とカーボンシートが 接触し導通を始め,さらに強く力が加わると接触面積が増 加,抵抗値が力に反比例するように減少する.

2.2.2. ひずみゲージ概要

ゲージに力が加わりせん断ひずみが発生した際のせん断 ひずみ $\gamma$ と抵抗 R の関係式は以下のようになる.ここで R は抵抗, K は使用ゲージのひずみ感度 ( $\Rightarrow$ 2),  $\gamma$ はせん断 ひずみである.

フックの法則 ( $\tau = G\gamma$ ) よりせん断ひずみから把持部 にかかる応力を推定することができる.



(a) Overall view (b) Image view of hereight for the fig.1 Forceps type adhesion device



Fig.2 Temperature control system



Fig.3 Principle of force sensitive resistor (FSR)

#### 3. 実験方法

### 3.1. 感圧センサ特性評価

実験装置を図4に示す. 図左側よりX軸ステージで図右 方向に一定の力を感圧センサに加えたときの電圧を計測し た. 印加力は荷重変換機で計測し0~20Nまで5N刻みと した. 計測時間は30 sec,計測回数は1つの条件につき5 回とし,30 secの平均値をとり,さらに5回の平均をとっ た.



Micrometer driven stage

Fig.4 Force sensitive experiment system

## 3.2. ひずみゲージ測定

図5に実験装置を示す.融着デバイスの把持部付近にひ ずみゲージを取り付け,把持部に一定の力を加えたときの 電圧を計測した.把持部中央に重りをつるし,印加力とし た.印加力は0~140Nまで10N刻みとし,計測時間は30 sec,計測回数は1つの条件につき5回とし,30 secの平均 値をとり,さらに5回の平均をとった.また得られた測定 電圧と印加力の関係式より補正をかけたひずみゲージを用 いて実際に手で把持し,3 段階の強さで把持した際の印加 力を計測した.



Fig.5 Strain gauge experiment system

## 4. 結果

#### 4.1. 感圧センサ個別特性評価結果

感圧センサに印加力 10 N を加えたときの測定電圧の一 例を図 6 に示す.センサに力を加えていると電圧が徐々に 増加していることがわかる.力の大きさと測定電圧の関係 を図 7 に示す.加える力が大きくなるにつれ,対数関数的 に測定電圧の大きさが大きくなることがわかる.また低印 加力ほど測定電圧のばらつきが大きい.



#### 4.2. ひずみゲージ測定結果

ひずみゲージを取り付けた鉗子の把持部に印加力 10 N を加えたときの測定電圧の一例を図8に、印加力と測定電 圧の関係を図9に、図9の関係を使用して実際に把持した ときに把持部にかかる力及び先端圧を計測した例を図10 に示す.測定電圧に若干のノイズは見られるが一定の値付 近に留まっている.印加力に対して測定電圧は比例関係に あり、測定毎のばらつきも小さい.手で把持すると把持部 に約50 N~90 N ほどの力が加わっており、先端のヒータに かかる圧力を算出すると約4.5 MPa~8.0 MPa 加わってい ることになる.これは先行研究の必要圧力1.25 MPa を十分 に満たしている.



# Fig.10 Measured force and forceps pressure with strain gauge 5. 結言

本研究は鉗子型融着デバイス接合時に試料にかかる圧力 を計測するため、デバイス把持部にかかる力を計測するセ ンサの検討を行った.感圧センサは一定の力が加わってい ると常に測定電圧が上昇してしまう、測定毎の振れ幅が大 きいといった問題があった.これに対してひずみゲージは 測定電圧の変動が小さく、測定毎の振れ幅も小さいことが わかった.以上のことよりひずみセンサを用いて接合時に 試料にかかる圧力測定が可能となった.

#### 6. 参考文献

(1) 猪野学, 増澤徹, 青代敏行, 加藤綾子, 岸田晶夫, 樋 上哲哉,「低エネルギ生体融着デバイスの発熱機構の 開発」, 日本生体医工学会関東支部若手研究者発表会 2010予稿集, B-3-2